#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06157076 A

(43) Date of publication of application: 03.06.94

(51) Int. CI

C03C 17/02 E06B 3/02

(21) Application number: 04303711

(22) Date of filing: 13.11.92

(71) Applicant:

**CENTRAL GLASS CO LTD** 

(72) Inventor:

TAKAMATSU ATSUSHI TAKAHASHI OSAMU ARAI HIROAKI

#### (54) LOW REFLECTING GLASS AND ITS **PRODUCTION**

(57) Abstract:

PURPOSE: То improve reflection preventing characteristics by blending plural compounds having different average molecular weights among specific Si compounds with a solution to give a coating solution, coating a glass substrate with the coating solution while controlling relative humidity and heating to form a film.

CONSTITUTION: Two or more compounds having different average molecular weights of several thousands and several hundreds thousands among

alkoxide-based or Si acetylacetonate-based compound such as tetramethoxysilane are blended with a solvent in the molecular ratio of the low-molecular weight component/the high-molecular weight component of 1-30 and aged at 20-80°C to prepare a coating solution. Then a glass substrate having the cleaned surface is immersed in the coating solution adjusted to 1-10 centipoise in an environment of 40-90% relative humidity, pulled up, dried at about 100°C to form a coating film. Then the glass substrate is burnt to give low reflecting glass having formed a thin film of a micropit-like or an uneven surface layer with 60-160nm film thickness, 50-200nm diameter and 1.21-1.40 refractive index.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平6-157076

(43)公開日 平成6年(1994)6月3日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 3 C 17/02

B 7003-4G

E 0 6 B 3/02

### 審査請求 未請求 請求項の数7(全 7 頁)

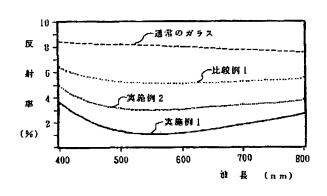
	10 mm - 10 mm	
(21)出願番号	<b>特願平4-3037</b> 11	(71)出願人 000002200
		セントラル硝子株式会社
(22) 出願日	平成4年(1992)11月13日	山口県宇部市大字沖宇部5253番地
		(72)発明者 高松 敦
		三重県松阪市大口町1510 セントラル硝子
		株式会社テクニカルセンター内
		(72)発明者 髙橋 修
		三重県松阪市大口町1510 セントラル硝子
		株式会社テクニカルセンター内
		(72)発明者 荒井 宏明
		三重県松阪市大口町1510 セントラル硝子
		株式会社テクニカルセンター内
		(74)代理人 弁理士 坂本 栄一

## (54)【発明の名称】 低反射ガラスおよびその製法

## (57) 【要約】

【構成】ガラス基板の表面上に、該薄膜がSiアルコキシド系化合物或いはSiアセチルアセトネート系化合物の中から少なくとも1種以上の化合物を二つ以上選択し、しかも該選択した二つ以上の化合物における平均分子量が異なるものであって、該二つ以上の化合物を溶剤と共に混合してコーティング溶液とし、該溶液の選択する二つ以上の化合物の混合割合の調整又は/及び該溶液を湿度環境を制御する中で被膜し、加熱成膜して成る、マイクロピット状表層又は凹凸状表層であるゾルゲル膜において、該層の膜厚が60~160nm、該状径が50~200nmで、しかも屈折率が1.21~1.40である低反射ガラス。並びにその製法。

【効果】手軽に容易な膜形成手段でもって薄膜を安価に 効率よく得られ、該薄膜で特異な形状を有する頑固な表 層となり、単層膜で低反射特性を有して充分その性能を 発揮し、光学特性を損わず、密着性や耐候性等に優れ、 建築用窓材をはじめ各種ガラス物品や種々の被覆膜に広 く採用できる有用なものとなる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス基板の表面上に形成した薄膜にお いて、該薄膜がSiアルコキシド系化合物あるいはSi アセチルアセトネート系化合物のなかから少なくとも1 種以上の化合物を二つ以上選択し、しかも該選択した二 つ以上の化合物における平均分子量が異なるものであっ て、該二つ以上の化合物を溶剤とともに混合してコーテ ィング溶液とし、該溶液の選択する二つ以上の化合物の 混合割合の調整または/および該溶液を相対温度のコン ピット状表層または凹凸状表層であるゾルゲル隙におい て、該マイクロピット状表層または凹凸状表層の膜厚が 60~160 nmで、かつ、該マイクロピット状または 凹凸状の径が50~200nmであり、しかもその屈折 率が1.21~1.40であることを特徴とする低反射 ガラス。

【請求項2】 前記選択した二つ以上の化合物における 異なる平均分子量としては、一つの低平均分子量の化合 物が数千であって、他の一つ以上の高平均分子量の化合 物が数万乃至数十万であることを特徴とする請求項1記 20 載の低反射ガラス。

【請求項3】 前記選択する二つ以上の化合物の混合割 合の調整が、高平均分子量の化合物 1 mol に対して、 低平均分子量の化合物を酸化物換算で0.1~30mo 1であることを特徴とする請求項1および2記載の低反 射ガラス。

ガラス基板の表面上に形成した薄膜にお 【請求項4】 いて、該薄膜がSiアルコキシド系化合物あるいはSi アセチルアセトネート系化合物のなかから少なくとも1 種以上の化合物を二つ以上選択し、しかも該選択した二 30 つ以上の化合物における平均分子量が異なるものであっ て、該二つ以上の化合物を溶剤とともに混合してコーテ ィング溶液とし、該溶液の選択する二つ以上の化合物の 混合割合の調整または/および該溶液を相対湿度のコン トロールのもとに被膜し、100°C以上の温度で加熱 成膜して成る、マイクロピット状表層または凹凸状表層 であるゾルゲル膜において、該マイクロピット状表層ま たは凹凸状表層の膜厚を60~160nmで、かつ該マ イクロピット状または凹凸状の径が50~200nmに なるようにするとともに、その屈折率を1.21~1. 40にすることを特徴とする低反射ガラスの製法。

【請求項5】 前記コーティング溶液を、1~10cP に粘度調製することを特徴とする請求項4記載の低反射 ガラスの製法。

【請求項6】 前記コーティング溶液の酸化物換算固形 分濃度が0.01~10wt%であることを特徴とする 請求項4ならびに5記載の低反射ガラスの製法。

【請求項7】 前記コーティング溶液を塗布するに際 し、コントロールする前記相対湿度が、40~90%で スの製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、マイクロピット状表層 または凹凸状表層を有し、しかも大きさをコントロール することができるゾルゲル膜である低反射ガラスならび にその製法に関し、該低反射ガラスは、刺激純度、反射 の低下率等の光学特性が高性能であって、しかも単純か つ安全な工程でもって製造できるので安価であり、また トロールのもとに被膜し、加熱成膜して成る、マイクロ 10 大面積化も可能で均一な成膜となり、頑固な密着力で耐 摩耗性あるいは耐久性等が優れたものとなり、ことに建 築用窓材をはじめ、ことに屋内用の各種膜付きガラス物 品において有用となる低反射ガラスおよびその製法を提 供するものである。

[0002]

【従来の技術とその問題点】従来、大面積のガラスの反 射率を低下させる方法として代表的なものとしては例え ば、ガラス表面に、厚さ約100nm程度で屈折率がガ ラスより低い層を形成する方法、あるいは2層以上に積 層した薄膜の多重干渉を利用して予め計算により設計さ れた高屈折率膜・低屈折率膜を交互に積層した多層膜を 形成する方法等がある。

【0003】先ず、前者の例としては、特公昭41-6 66号公報あるいは特公平2-14300号公報等に開 示されているように、弗化水素等により、ガラス表面を エッチングする方法および珪弗化水素酸のシリカ過飽和 水溶液によりシリカのポーラスな被膜を形成する方法が ある。

【0004】これらの方法は、製造工程が簡単とは必ず しも言えず製造時間がかかる方法であり、低反射特性は よいとしても大面積化した際に製品面内あるいは製品間 の光学特性のパラツキが多いといった問題点があり、比 較的高価格な低反射ガラスとなるものである。さらに原 料として弗酸を用いるため、人体に対して危険であり、 取扱いが厄介である。

【0005】また、その他の方法としては、加熱処理に より、燃焼や分解する有機高分子を金属アルコキシド溶 液中に添加する方法があり、一度形成されたマイクロピ ット状が例えば400℃程度以上の加熱処理により緻密 40 化を起こすため、熱処理条件をきびしく制御する必要が あって、均一で頑固なマイクロピット状の被膜を得るこ とが非常に困難である。

【0006】さらに、前記した高屈折率膜・低屈折率膜 を交互に積層し、薄膜の多重干渉を利用した反射の低い ガラスを製造する方法は、実際に建築用あるいは産業用 または車両用等に広く採用されているものの、複雑な作 業工程を伴い、必ずしも高効率で経済性が良いとは言え ないものであり、また多重干渉を利用した低反射ガラス は斜入射での反射率が高く、しかも刺激純度が高いた あることを特徴とする請求項4乃至6記載の低反射ガラ 50 め、ギラツキ感があるといった問題点もあるものであ る。さらにまた、例えば特公平3-23493号公報には防 汚性を有する低反射率ガラスが記載されているが、該膜 の最終加熱温度は400℃以下、例えば160~200℃程度に することとなり、最上膜の硬度や強度が低いものしか得 ることができないという問題点がある。

[0007]

【問題点を解決するための手段】本発明は、従来のかか る問題点に鑑みてなしたものであって、特定のSiアル コキシド系化合物あるいはSiアセチルアセトネート系 組み合わせ、混合割合を変化させたコーティング溶液と するようにし、被膜の際の相対湿度を制御する特定の湿 度環境下での塗布条件で塗布し、焼成することにより、 充分焼成をしても、独立してしっかりした特定の膜厚な らびに特定の径を有する特異な種々の表面表層、ことに マイクロピット状細孔様または凹凸状様あるいはこれら が適宜共存様の表面表層を有するゾルゲル膜をなし、高 密着性であって耐久性や耐摩耗性とを併せ持ち、単層で 薄膜の見かけの屈折率を低下させることができ、反射防 止特性に優れてギラツキ感もなく、高安全で厄介な作業 20 工程がなく、安価に効率よく得られることとなる等、種 々の分野に採用できる利用価値の高い低反射ガラスおよ びその製法を提供するものである。

【0008】すなわち、本発明は、ガラス基板の表面上 に形成した薄膜において、該薄膜がSIアルコキシド系 化合物あるいはSiアセチルアセトネート系化合物のな かから少なくとも1種以上の化合物を二つ以上選択し、 しかも該選択した二つ以上の化合物における平均分子量 が異なるものであって、該二つ以上の化合物を溶剤とと もに混合してコーティング溶液とし、該溶液の選択する 二つ以上の化合物の混合割合の調整または/および該溶 液を相対湿度のコントロールのもとに被膜し、加熱成膜 して成る、マイクロピット状表層または凹凸状表層であ るゾルゲル膜において、該マイクロピット状表層または 凹凸状表層の膜厚が60~160nmで、かつ、該マイ クロピット状または凹凸状の径が50~200nmであ り、しかもその屈折率が1.21~1.40であること を特徴とする低反射ガラス。

【0009】ならびに、前記選択した二つ以上の化合物 における異なる平均分子量としては、一つの低平均分子 40 量の化合物が数千であって、他の一つ以上の高平均分子 量の化合物が数万乃至数十万であることを特徴とする上 述した低反射ガラス。

【0010】さらに、前記選択する二つ以上の化合物の 混合割合の調整が、高平均分子量の化合物1m01に対 して、低平均分子量の化合物を酸化物換算で0.1~3 0mo1であることを特徴とする上述した低反射ガラ

【0011】また、ガラス基板の表面上に形成した薄膜 において、該薄膜がSiアルコキシド系化合物あるいは 50

Siアセチルアセトネート系化合物のなかから少なくと も1種以上の化合物を二つ以上選択し、しかも該選択し た二つ以上の化合物における平均分子量が異なるもので あって、該二つ以上の化合物を溶剤とともに混合してコ ーティング溶液とし、該溶液の選択する二つ以上の化合 物の混合割合の調整または/および該溶液を相対温度の コントロールのもとに被膜し、100°C以上の温度で 加熱成膜して成る、マイクロピット状表層または凹凸状 表層であるゾルゲル膜において、該マイクロピット状表 化合物を選び、該化合物の平均分子量が異なるものから 10 層または凹凸状表層の膜厚を $60\sim160$  nmで、かつ 該マイクロピット状または凹凸状の径が50~200 n mになるようにするとともに、その屈折率を1.21~ 1. 40にすることを特徴とする低反射ガラスの製法。

> 【0012】ならびに、前記コーティング溶液を、1~ 10 c P に粘度調製することを特徴とする上述した低反 射ガラスの製法。さらに、前記コーティング溶液の酸化 物換算固形分濃度が0.01~10wt%であることを 特徴とする上述した低反射ガラスの製法。

【0013】さらにまた、前記コーティング溶液を塗布 するに際し、コントロールする前記相対温度が、40~ 90%であることを特徴とする上述した低反射ガラスの 製法をそれぞれ提供するものである。

【0014】ここで、前記したように、Siアルコキシ ド系化合物あるいはSiアセチルアセトネート系化合物 のなかから少なくとも1種以上の化合物を二つ以上選択 したのは、該両化合物は安定性があって、溶液調製の 際、例えば平均分子量の制御が容易であり、成膜した前 記マイクロピット状表層、凹凸状表層の種々の表面形状 を有する酸化物薄膜の透明性や硬度が高く、耐久性にも 優れたものとなり、比較的安価で入手し易いものである ので該両化合物を用いることとした。

【0015】また、Siアルコキシド系化合物として は、Siにすべてアルコキシ基のみが結合した場合、す なわちメトキシド、エトキシド、イソプロポキシド等の みならず、その一部がメチル基、エチル基等に置換した もの、例えばモノメチルアルコキシド、モノエチルアル コキシド等を含むものである。さらにまた、Siアセチ ルアセトネート系化合物としては、Siにすべてアセチ ルアセトン基のみが結合した場合のみならず、その一部 がメチルアルコキシ基、エチルアルコキシ基等に置換し たものを含むものである。

【0016】さらに、具体的なものとしては、例えばテ トラメトキシシラン (Si (OMe) 4 H: ]、テトラエトキシシラン (Si (OEt), t: C2 H5 ]、メチルトリエトキシシラン [MeSi (OEt)₃]、メチルトリメトキシシラン[MeSi (OMe) 3 )等が好適であり、他には例えばジメチル ジエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン等があ

【0017】さらにまた、前記選択した二つ以上の化合

5

物における平均分子量が異なるものとしたのは、被膜した薄膜の表層をマイクロピット状、凹凸状とするためであり、混合する 2 種以上の化合物の平均分子量は数千(具体的には  $800\sim5$ , 000程度、好ましくは 2,  $000\sim3$ , 000程度)と数万から数十万(具体的には 50,  $000\sim400$ , 000程度)の組み合わせがよいものである。

【0018】一方、平均分子量の制御は、溶液を調製する際において、触媒の種類(例えば塩酸、硝酸、酢酸等)、その添加量すなわち PH 値(例えば  $PH=1\sim10$ 6、好ましくは  $2\sim4$ )および反応温度(例えば  $2\sim4$ 0~80°C、好ましくは  $25\sim70$ °C)等によって、加水分解反応過程あるいは縮重合過程をコントロールすることにより行うものである。ただし、化合物によってはそれぞれ反応時間等も異なり、必ずしもすべてに共通しない場合もあり得るものである。

【0019】また、マイクロピット状表層、凹凸状表層の形状の制御は、混合する2種以上の化合物の平均分子量が数千と数万から数十万である化合物の混合割合が、その溶質モル比(酸化物換算)で0.1~30程度であり、0.1未満あるいは30を超えると平坦な平面形状となるものである。なかでも1~20程度が好ましく、より好ましくはマイクロピット状表層では2~5.5程度、凹凸状表層では5.5~7程度である。また、前記表層におけるそれぞれの大きさは被膜する際の相対湿度により制御することができ、約40%程度の場合約50nm程度となり、約90%程度の場合約200nm程度となる。

【0020】また、前記Siアルコキシド系化合物あるいはSiアセチルアセトネート系化合物のアルコール溶 30液中の濃度については、0.1wt%程度以上が好ましく、これ未満であれば均一な前記3種類の表面形状表層を有する被膜を次第に形成し難くなり、他方、10wt%程度を超えると、溶液が粘稠となり、前記3種類の表層形状はあるものの、クラックの発現等があり、加えて膜付け自体が困難となるものである。さらに本アルコール溶液におけるアルコール溶媒としては、イソプロピルアルコールあるいは1ーブタノール等が採用できるものである。

【0021】さらにまた、ガラス基板への膜付け法としては、ディッピング法、スプレー法、フローコート法あるいはスピンコート法等既知の塗布手段が適宜採用し得るものである。また前記コーティング溶液を被膜後、1層の薄膜を形成する毎に、約100°C程度の雰囲気温度下で約30分間以内程度の乾燥を行い、前記2種類の表層形状を有したゲル膜を形成することが好ましいものである。

【0022】またさらに、本発明の2種類の表面形状表 用できるこの層については、縮重合度の違いによる形成であって、膜 スに使用する強固にするための焼成(例えば約500°C以上)に 50 が好ましい。

よっても消失することもなく、しかも独立したピットあるいは凹凸状物が表面および基板との界面付近まで形成されており、走査電子顕微鏡による5千倍で明確に観察が可能である等、膜強度に優れるしっかりした前記2種類の表面形状表層とできるものである。

【0023】またさらに、該マイクロピット状表層また は凹凸状表層の膜厚を60~160nmで、かつ該マイ クロピット状または凹凸状の径が50~200nmにな るようにするとともに、その屈折率を1.21~1.4 0にするようにしたのは、先ず膜厚が60~160nm の範囲外では充分な膜強度を有しつつパランスがある所 期の低反射率とならないからであり、またマイクロピッ ト状または凹凸状の径が50~200nmの範囲内にな るようにするのは、50nm未満では膜強度は強いもの の低反射効果があまり出現せず、200nmを超えると 膜強度が顕著な低下を示すとともに屈折率が下がりすぎ 低反射効果が逆に悪化することとなるからであって、1 00~150nm程度が好ましいものであり、さらに屈 折率が1.21~1.40の範囲内とするのは、低反射 効果に最適な屈折率は1.21程度であるが該数値未満 では膜強度が充分満足を得るものとならず、1.40を 超えると所期の低反射効果を得ることができ難くなるか らであり、1.3~1.4または1.39程度が好まし いものである。いずれにしてもこれら膜厚、マイクロピ ット状または凹凸状の径ならびに屈折率が前記範囲内で 適宜巧みに組み合わさることによって、所期の低反射ガ ラスを得ることができ、より好ましいものである。

【0024】また例えばHF等によるエッチングでは、その構造上エッチングされ易い部分とされ難い部分とがあって、エッチングされ易い部分がピット状のものとなるので、どちらかと言えば連続的であり、膜厚もピット制御も困難であり、前記倍率でのピット観察では観察が困難である。また例えばゾルゲル膜での有機高分子物、溶媒、水分の焼成等による多孔質化では、通常250~300°C付近の焼成で膜全体が一度多孔質化するが、500°C以上で焼成した場合、膜の緻密、硬化が起こり、無孔化も同時に起こり、ピット状のものは膜表面および内部でなくなり、走査電子顕微鏡では3~5万倍で観察しても、表面形状は平坦である等、従来法のものと本発明のマイクロピット状表層あるいは凹凸状表層とでは明らかに異なるものであった。

【0025】さらにまた、前記ガラス基板としては、無機質の透明板ガラスであって、無色または着色、ならびにその種類あるいは色調、形状等に特に限定されるものではなく、さらに曲げ板ガラスとしてはもちろん、各種強化ガラスや強度アップガラス、平板や単板で使用できるとともに、複層ガラスあるいは合せガラスとしても使用できることは言うまでもない。なお、ことに合せガラスに使用する際には空気側となる片面のみ成膜することが好ましい。

7

[0026]

【作用】前述したとおり、本発明のマイクロピット状表 層あるいは凹凸状表層を有するゾルゲル膜、ならびにそ の形成法により、上述した特定系の二つの化合物を選 び、該化合物の平均分子量を異なるものを少なくとも組 み合わせることで、高温焼成しても、緻密化することな く、従来より独立性があって深見のある、明確でしっか りしたマイクロピット状あるいは凹凸状表層となり、し かも該2種類の表面表層の形状とその径を制御でき、付 着性も向上し頑固な薄膜とすることでき、ガラス基板と 10 の界面は密着性を格段に向上せしめ、優れた耐久性を有 するものとなり、透明で硬度が高く、しかも反射防止特 性に優れており、光学特性等も充分に満足できるものと でき、高安全で厄介な作業工程がなく、安価に効率よく 得られることとなるものである。

[0027]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。ただし本発明は係る実施例に限定されるものではな 14.

#### 【0028】実施例1

大きさ約100mmx100mm、厚さ約3mmのクリ ア・フロートガラス基板を中性洗剤、水すすぎ等で順次 洗浄し、乾燥した後、被膜用のガラス基板とした。

【0029】平均分子量が約3,000で固形分濃度が 約30wt%のメチルトリエトキシシラン溶液約20. 0gと、平均分子量が約100,000で固形分濃度が 約6wt%のシリコンエトキシド溶液約28.6gをビ 一カーに入れ、低平均分子量の固形分/高平均分子量の 固形分を約3.50mol比とし、次いで1ープタノー ル約150gで希釈し、約8時間攪拌後、約2週間熟成 30 してコーティング溶液を得た。

【0030】つぎに、成膜ブースで囲まれた温度約23 ℃、相対湿度約60%の環境下で、前記ガラス基板を該 溶液中に浸漬し引き上げ速度が約2.3mm/sのスピ ードで引き上げるディッピング法により、該溶液を前記 ガラス基板の両表面に被膜し、約3分間程度静かに乾燥 させた後、約270°Cで約10分間加熱してゲル膜を 形成した。さらにこれを約550℃程度で約10分程度 加熱し成膜した。

【0031】得られた薄膜は、走査電子顕微鏡(SE 40 M) により、約2万倍の倍率で表面形状状態を観察した ところ、図1に示すように、その径が約100~150 nm程度のマイクロピット状で細孔様の表層となってお り、非常にポーラスな薄膜であった。またエリプソメー 夕等による測定から、屈折率が約1.33程度であっ て、膜厚が約105nmのSiOz薄膜を成膜した。

【0032】該両面薄膜付ガラス基板の反射率は、JI S 28722から図4に示すように、約550nmで 約1.1%、可視光線反射率(D65光線-Y値)は約 1.2%であり、非常に高性能な低反射ガラスとなっ 50 線一Y値)は約5.7%であり、低反射ガラスとは言い

た。

【0033】さらに該薄膜の膜強度は、比較的に強く、 払拭等では膜にキズを発現するようなものではなかっ

8

#### 実施例2

実施例1と同様なガラス基板とコーティング溶液を用 い、他は実施例1と同様にし、引き上げ速度を約3mm /s でディッピング成膜し、約3分間静かに乾燥させた 後、約270℃で約10分加熱してゲル膜を形成した。 これを約600℃で約10分間加熱処理して成膜した。

【0034】得られた薄膜は、実施例1と比べて緻密化 が少々進んでいるものの、実施例1と同一条件で表面形 状状態を観察したところ、図2に示すように、その径が 約100nm前後程度のマイクロピット状で細孔様の表 層となっており、ポーラスな薄膜であった。また実施例 1と同様の測定から、屈折率が約1.395程度であっ て眼鏡等に広く使われている弗化マグネシウムに近い屈 折率であり、膜厚が約100nmのSiOz 薄膜を成膜 した。

20 【0035】該両面薄膜付ガラス基板の反射率は、図4 に示すように、約550nmで約3%、可視光線反射率 (D65光線-Y値)は約3.1%であって実施例1に 比べると低反射特性はやや低いものの、所期の低反射ガ ラスとなった。

【0036】さらに、テーパー摩耗特性は、摩耗輪がC S-10Fで荷重が500gfの条件により、100回 の回転でヘーズ (△H) 値が約0.8%であって、耐摩 耗性に優れた高硬度な低反射ガラスであった。

#### 【0037】比較例1

実施例1と同様なガラス基板に、実施例1の平均分子量 が約100,000で溶質濃度が約0.4mo1%のシ リコンエトキシドのプタノール溶液を、実施例1と同様 の環境下で、引き上げ速度を約3.5mm/sのスピー ドでガラス基板の両面にディッピング法被膜し、実施例 1と同様な条件で熱処理し成膜した。

【0038】得られた薄膜は、実施例1と同様な測定と 評価により、図3に示すように、非常に平坦な表面表層 であって、その屈折率が約1. 45と高く、膜厚が約9 5 nmの両面膜付ガラスとなって、その反射率は、図4 に示すように、約550nmで最低となり、可視光線反 射率(D65光線ーY値)は約5.2%であり、必ずし も高性能な低反射ガラスとは言い難いものであった。

## 【0039】比較例2

実施例2と同様な方法において、ディッピングの引き上 げスピードを約0.5mm/sにして被膜し、実施例2 と同条件で加熱成膜したところ、屈折率が約1. 40で 膜厚が約50nmであって、実施例2に近い表面表層を 有する両面膜付ガラスとなって、その反射率は400n m以下の波長で最低となり、可視光線反射率(D65光 9

難いものであった。

#### 【0040】比較例3

実施例2と同様な方法において、ディッピングの引き上げスピードを約6mm/sにして被膜し、実施例2と同条件で加熱成膜したところ、屈折率が約1.39で膜厚が約170nmであって、実施例2に近い表面表層を有する両面膜付ガラスとなって、その反射率は780nm以上の波長で最低となり、可視光線反射率(D65光線一Y値)は約7.1%であり、低反射ガラスとは言い難いものであった。

#### 【0041】比較例4

実施例1と同様な方法において、1ープタノールを約50g再添加した溶液を使用し、ディッピングの引き上げスピードを約1mm/sにして被膜し、実施例1と同条件で加熱成膜したところ、屈折率が約1.33で膜厚が約50nmであって、実施例1に近い表面表層を有する両面膜付ガラスとなって、その反射率は400nm以下の波長で最低となり、可視光線反射率(D65光線ーY値)は約5%であり、低反射ガラスとは言い難いものであった。

## 【0042】比較例5

実施例1と同様な方法において、ディッピングの引き上げスピードを約8mm/sにして被膜し、実施例1と同条件で加熱成膜したところ、屈折率が約1.33で膜厚が約180nmの実施例1に近い表面表層を有する両面膜付ガラスとなって、その反射率は780nm以上の波長で最低となり、可視光線反射率(D65光線-Y値)は約6.9%であり、低反射ガラスとは言い難いものであった。

[0043]

【発明の効果】以上前述したように、本発明によれば、手軽に容易な膜形成手段でもって薄膜を安価に効率よく得られ、該薄膜において特異な形状を有する頑固なマイクロピット状表層あるいは凹凸状表層が得られ、しかもその径を制御することができるようになり、単層膜で反射防止特性に優れており、格段にその性能を発揮して、光学特性を損なうことなく、密着性、耐候性等に優れるものとなる等、建築用窓材等をはじめ、各種ガラス物品など、種々の被覆膜に広く採用できる利用価値の高い、有用なマイクロピット状表層あるいは凹凸状表層を有する低反射ガラスならびにその製法を提供するものである。

10

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1の低反射ガラスにおける、本発明のマイクロピット状表層を有するゾルゲル膜の表層面を、走査電子顕微鏡で観察処理した写真であって、マイクロピット状表層の状態を詳細に示す図である。

【図2】実施例2の低反射ガラスにおける、本発明のマ 20 イクロピット状表層を有するゾルゲル膜の表層面を、走 査電子顕微鏡で観察処理した写真であって、マイクロピ ット状表層の状態を詳細に示す図である。

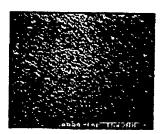
【図3】比較例1における、平坦表面を有するゾルゲル 膜の表層面を、走査電子顕微鏡で観察処理した写真であ り、平坦な表面状態を詳細に示す図である。

【図4】実施例1ならびに実施例2の低反射ガラス、比較例1のガラス、さらに通常のガラスにおける、各波長に対する反射率(%)を示す分光反射特性図である。

[図1]



【図2】



[図3]



【図4】

